

大型真空蒸着装置 ED-3100



大型真空蒸着装置ED-3100はマスフローコントローラ式ガス導入系をもっているため、反応性蒸着が可能です。光学式と水晶式の2種類の膜厚モニターによって、各種の膜厚制御が可能です。

大型真空蒸着装置 ED-3100 仕様

- 到達圧力 ×10⁻⁵Pa以下※常温・無負荷・脱ガス時
- 真空室径 φ700mm×700mmH SUS304 電解研磨
- 蒸着機構 電子銃最大投入電力:10kW
ルツボ容量:10mL×2/40mL×2
ルツボ個数:4個
- 基板回転 基板形状:250mm×250mm
磁気シール駆動方式 0~30rpm
- 基板加熱 マイクロシースヒーター
常温~300℃迄昇温可能
制御方式:サイリスタ制御・PID方式デジタル温調計
- 膜厚計 光学式膜厚計・水晶振動式膜厚計
- 真空排気系 油回転ポンプ:1300L/min[60Hz]
メカニカルブースターポンプ:300m³/h[60Hz]
油拡散ポンプ:5400L/sec
- 真空計 大気圧検知器/ピラニ真空計/電離真空計
- 操作方法 排気系全自動(手動操作も可)
- ユーティリティ電気: AC200V三相20kVA
冷却水:20L/min以上0.2MPa以上0.25MPa以下25℃以下循環
計装エア:0.5MPa以上
設置寸法:1800mmW×2400mmD×1900mmH